

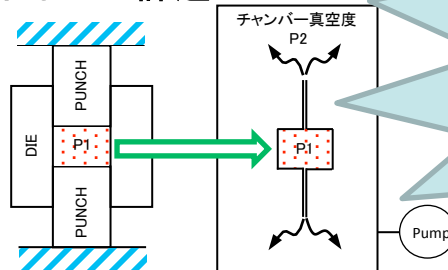
▽ SPS2000 新世代SPS(放電プラズマ焼結)装置



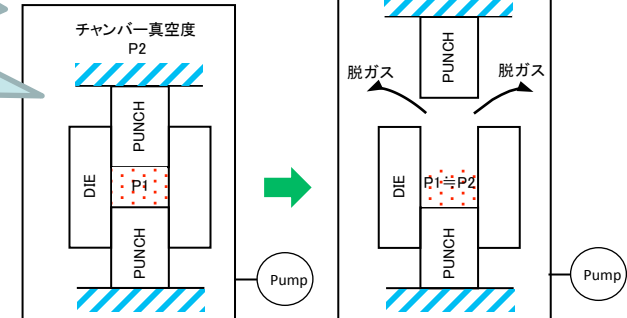
特許第7578259号
特許第7602302号

DEGAS モード
SPS2000標準装備

これまでの課題



SPS2000が
高純度焼結を
実現します



P1空間の圧力は焼結時の加熱による粉体表からのガス放出により、圧力が高まります。

また、チャンバー内圧力を高真空にしても、P1の排気経路のコンダクタンスが極小なため、排気困難となり、粉体に付着していた成分が焼結体に含まれてしまう問題がありました。

真空チャンバー内で粉体予備加熱を行い、真空状態を保ったまま粉体上面を開放できます。そのため、効率良く粉体からのガス放出を排気することができ、焼結体の純度を高めることができます。